

# POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

## KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek studiów: Fizyka Techniczna - New

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod kierunku: FT new

Stopień studiów: II

Specjalności: Nowoczesne materiały i nanotechnologie - New, Modelowanie Komputerowe - New

### 1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

|   |  |
|---|--|
| NAZWA PRZEDMIOTU                        | Własność intelektualna w twórczości multimedialnej |
| NAZWA PRZEDMIOTU<br>W JĘZYKU ANGIELSKIM | intellectual property in multimedia creation       |
| KOD PRZEDMIOTU                          | WIMiF FT NEW oIIS A3 21/22                         |
| KATEGORIA PRZEDMIOTU                    | Przedmioty ogólne                                  |
| LICZBA PUNKTÓW ECTS                     | 2.00   |
| SEMESTRY                                | 3  |

### 2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

| SEMESTR | WYKŁAD | ĆWICZENIA | LABORATORIUM | LABORATORIUM<br>KOMPUTERO-<br>WE | SEMINARIUM | PROJEKT |
|---------|--------|-----------|--------------|----------------------------------|------------|---------|
| 3       | 15     | 0         | 0            | 0                                | 0          | 0       |

### 3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami systemu ochrony własności intelektualnej.

## 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

## 5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

**EK1 Wiedza** Uzyskanie wiedzy dotyczącej systemu ochrony własności intelektualnej.

**EK2 Umiejętności** Nabycie umiejętności zabezpieczania wyników badań.

**EK3 Umiejętności** Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu zarządzania własnością intelektualną.

**EK4 Kompetencje społeczne** Student potrafi zgodnie z prawem korzystać z przedmiotów chronionych prawami wyłącznymi.

## 6 TREŚCI PROGRAMOWE

| WYKŁAD    |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| LP        | TEMATYKA ZAJĘĆ<br>OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH  | LICZBA<br>GODZIN |
| <b>W1</b> | Prawo autorskie, pojęcie utworu, prawa osobiste, prawa majątkowe, zasady ochrony, roszczenia z tytułu naruszenia prawa autorskiego, plagiat.  | 4                |
| <b>W2</b> | Patenty, prawo do patentu, zasady uzyskiwania patentów, przedmioty wyłączone z patentowania, postępowanie zgłoszeniowe, rodzaje patentów, SPC, system ochrony patentów, zasady ochrony patentowej, roszczenia z tytułu naruszenia patentu, sprzeciw, unieważnienie patentu, ograniczenia prawa z patentu, licencje, budowa opisu patentowego. | 4                |
| <b>W3</b> | Znaki towarowe, definicja, zasady ochrony, systemy ochrony znaków towarowych, postępowanie zgłoszeniowe, zasady ochrony znaków towarowych, roszczenia w przypadku naruszenia znaku towarowego, sprzeciw, unieważnienie znaku towarowego. Oznaczenia geograficzne i pochodzenia - wzmianka.  | 2                |
| <b>W4</b> | Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych.   | 1                |
| <b>W5</b> | Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, ochrona know-how, ochrona oznaczenia przedsiębiorcy, ochrona produktu.  | 2                |
| <b>W6</b> | Prawo prasowe, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, dobra osobiste, świadczenie usług drogą elektroniczną.  | 1                |
| <b>W7</b> | Zarządzanie technologiami.  | 1                |

## 7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

**N1** Wykłady

**N2** Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie e learningowej umożliwiające prowadzenie zajęć zdalnie

**N3** Prezentacje multimedialne

**N4** Dyskusja

## 8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

| FORMA AKTYWNOŚCI   | ŚREDNIA LICZBA GODZIN<br>NA ZREALIZOWANIE<br>AKTYWNOŚCI |
|--|---|
| <b>Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:</b>                                     |   |
| Godziny wynikające z planu studiów   | 15  |
| Konsultacje przedmiotowe   | 0   |
| Egzaminy i zaliczenia w sesji  | 8   |
| <b>Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:</b> |   |
| Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury                               | 0   |
| Opracowanie wyników  | 0   |
| Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji   | 7   |
| <b>SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z<br/>CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA</b>    | <b>30</b>   |
| SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  | 2.00  |

## 9 SPOSOBY OCENY

### OCENA FORMUJĄCA

**F1** Obecność na wykładach albo sprawdzian pisemny lub ustny.

**F2** Praca pisemna na zadany temat związany z tematyką wykładów.

### OCENA PODSUMOWUJĄCA

**P1** Średnia ważona ocen formujących

### WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

**W1** Obecność na co najmniej połowie wykładów albo zaliczenie pisemne lub ustne.

**W2** Złożenie poprawnej pracy pisemnej.

### KRYTERIA OCENY

| EFEKT KSZTAŁCENIA 1 |  |
|---------------------|--|
| NA OCENĘ 2.0        | Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym. |

|                     |   |
|---------------------|---|
| NA OCENĘ 3.0        | Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.   |
| NA OCENĘ 3.5        | Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach  |
| NA OCENĘ 4.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.  |
| NA OCENĘ 4.5        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.   |
| NA OCENĘ 5.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie. |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 2 |   |
| NA OCENĘ 2.0        | Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.  |
| NA OCENĘ 3.0        | Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.   |
| NA OCENĘ 3.5        | Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach  |
| NA OCENĘ 4.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| NA OCENĘ 4.5        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.   |
| NA OCENĘ 5.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie. |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 3 |   |
| NA OCENĘ 2.0        | Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.  |
| NA OCENĘ 3.0        | Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.   |
| NA OCENĘ 3.5        | Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach  |
| NA OCENĘ 4.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.  |
| NA OCENĘ 4.5        | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.   |
| NA OCENĘ 5.0        | Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie. |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 4 |   |
| NA OCENĘ 2.0        | Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.  |

|              |   |
|--------------|---|
| NA OCENĘ 3.0 | Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.   |
| NA OCENĘ 3.5 | Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach  |
| NA OCENĘ 4.0 | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.  |
| NA OCENĘ 4.5 | Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.   |
| NA OCENĘ 5.0 | Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie. |

## 10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

| EFEKT KSZTAŁCENIA | ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU | CELE PRZEDMIOTU | TREŚCI PROGRAMOWE       | NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | SPOSOBY OCENY |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| EK1               | K_W11  | Cel 1           | W1 W2 W3 W4<br>W5 W6 W7 | N1 N2 N3 N4           | F1 F2 P1      |
| EK2               | K_U01b<br>K_U04b K_U12   | Cel 1           | W1 W2 W3 W4<br>W5 W6 W7 | N1 N2 N3 N4           | F1 F2 P1      |
| EK3               | K_W11<br>K_U01b K_U12<br>K_U13   | Cel 1           | W7                      | N1 N2 N3 N4           | F1 F2 P1      |
| EK4               | K_K01 K_K02<br>K_K03   | Cel 1           | W1 W2 W3 W4<br>W5 W7    | N1 N2 N3 N4           | F1 F2 P1      |

## 11 WYKAZ LITERATURY

### LITERATURA PODSTAWOWA

- [1 ] Autor **Joanna Sienczyło-Chlabicz** — *Prawo własności intelektualnej*, Miejscowość, 2020, Wolters Kluwer Polska

## 12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

### OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Andrzej Osak (kontakt: aosak@pk.edu.pl)

## 13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

---

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)